

**ZAKRES AKREDYTACJI
LABORATORIUM WZORCUJĄCEGO
SCOPE OF ACCREDITATION FOR CALIBRATION LABORATORY
Nr/No. AP 197**

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 5 z/of 13.08.2025

 AP 197	Nazwa i adres / Name and address MITUTOYO Polska Sp. z o.o. ul. Skrzypowa 1 54-530 Wrocław
Działalność prowadzona / Activity conducted poza stałą siedzibą (P) / at outside location (P)	Wzorcowanie / Calibration: Numer i nazwa wielkości mierzonej / number and name of measurand^{*)} 6.03 długość (geometria powierzchni) 6.04 długość (pomiar współrzędnościowe)

Wersja strony/Page version: A

^{*)} Numeracja wielkości mierzonych zgodna z podaną w załączniku nr 1 do dokumentu DAP-04 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl / The numbering of measurand in accordance with the classification given in the Annex to document DAP-04, available at PCA website www.pca.gov.pl

**KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI
WZORCOWAŃ**

KATARZYNA WIŚNIEWSKA

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AP 197 z dnia 30.06.2025 r.
Cykl akredytacji od do 13.08.2025 r. do 16.08.2029 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl

This document is an annex to accreditation certificate No. AP 197 of 30.06.2025
Accreditation cycle from 13.08.2025 to 16.08.2029
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl

Serwis Mitutoyo Polska Sp. z o.o. ul. Skrzypowa 1, 54-530 Wrocław				
Obiekt wzorcowania/pomiaru	Zakres pomiarowy	Niepewność pomiaru dla CMC	Miejsce dział.	Metoda pomiarowa
Długość (geometria powierzchni)				
Konturografy	G_{X0} 0 mm do 200 mm G_{XZ45} 0 mm do 60 mm E_{X1} 0 mm do 200 mm E_{Z1} 0 mm do 60 mm	$(0,1 + 0,035 \cdot L) \mu\text{m}$ $1,1 \mu\text{m}$ $(0,6 + 1,4 \cdot L) \mu\text{m}$ $(0,2 + 1,1 \cdot L) \mu\text{m}$ L – wielkość mierzona (m)	P	Procedura wewnętrzna PO_14_I01_S
- kąt	90° do 135°	0,003°		
Profilometry stykowe	R_a 0,1 μm do 0,4 μm 1 μm do 3 μm R_z 1 μm do 12 μm R_{zmax} 1 μm do 12 μm P_t 0 μm do 8 μm E_{Z1} 0 μm do 760 μm	$(0,012 + 0,050 \cdot R_a) \mu\text{m}$ $(0,017 + 0,030 \cdot R_a) \mu\text{m}$ $(0,089 + 0,030 \cdot R_z) \mu\text{m}$ $(0,128 + 0,030 \cdot R_{zmax}) \mu\text{m}$ $0,01 \mu\text{m}$ $0,10 \mu\text{m}$ R_a, R_z, R_{zmax} – wielkość mierzona (μm)	P	Procedura wewnętrzna PO_14_I01_S w oparciu o normę PN-EN-ISO-12179:2022-06E
Przyrządy do pomiaru odchyłek kształtu			P	Procedura wewnętrzna PO_14_I02_S w oparciu o normę PN-EN ISO 5463:2025-03E
- okrągłość	0 μm do 1,6 μm	0,011 μm		
- płaskość	0 μm do 1,6 μm	0,011 μm		
- prostoliniowość X	0 μm do 8 μm	0,012 μm		
- prostoliniowość Z ₂	0 μm do 8 μm	0,016 μm		
- równoległość Z ₂	0 μm do 16 μm	0,083 μm		
- walcowość	0 μm do 8 μm	0,1 μm		
- nachylenie	0 μm do 8 μm	0,012 μm		

Wersja strony: A

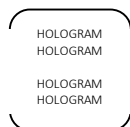
Obiekt wzorcowania/pomiaru	Zakres pomiarowy	Niepewność pomiaru dla CMC	Miejsce dział.	Metoda pomiarowa
Długość (pomiar współrzędnościowy)				
Główce pomiarowe optyczne	0,1 mm do 26 mm	0,2 μm	P	PN-EN ISO 10360-7:2011
Główce pomiarowe stykowe impulsowe	25 mm	0,2 μm	P	PN-EN ISO 10360-5:2020-10
Główce pomiarowe stykowe skanujące	25 mm	0,3 μm	P	PN-EN ISO 10360-5:2020-10
Optyczne współrzędnościowe maszyny pomiarowe z głowicą pomiarową rejestrującą obraz	10 mm do 900 mm	$(0,1 + 1,0 \cdot L) \mu\text{m}$ L – wielkość mierzona (m)	P	PN-EN ISO 10360-7:2011
Współrzędnościowe maszyny pomiarowe	10 mm do 5000 mm	$(0,1 + 0,3 \cdot L) \mu\text{m}$	P	PN-EN ISO 10360-2:2010 - interferometrem laserowym - wzorcem stopniowym
	10 mm do 1510 mm	$(0,3 + 0,4 \cdot L) \mu\text{m}$ L – wielkość mierzona (m)		

Wersja strony: A

Niepewność pomiaru dla CMC stanowi niepewność rozszerzoną przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95 % i jest wyrażona w jednostkach wielkości mierzonej.

Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AP 197

Status zmian: wersja pierwotna – A



Zatwierdzam status zmian

**KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI
WZORCOWAŃ**

KATARZYNA WIŚNIEWSKA
dnia: 13.08.2025 r.